

(별첨 2) 선도장비 전문연구지원과제 이용수가

1. HVEM

전문연구지원과제				이용수가 (부가세 포함, 단위:원)
장비시스템 영문명 (Fullname)	장비시스템 국문명	세부 분야	단 위	
High Voltage Electron Microscope	초고전압 투과전자현미경	일반관찰/분석	1 일 기준	770,000
		직접가열실험		
		직접저온실험		
		화학분석		
		전자토모그래피		

2. 15T-FT-ICR

전문연구지원과제				이용수가 (부가세 포함, 단위:원)
장비시스템 영문명 (Fullname)	장비시스템 국문명	세부 분야	단 위	
15 Tesla Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometer System	15T 푸리에르 전환 이온공명질량분 석기 시스템	직접 분석*	1 일 기준	550,000
		위탁 분석	1 일 기준	770,000

*직접분석은 2분기 이상 공동연구를 수행한 기관 중에서 최소 20시간 이상 분석과정에 참여하거나 장비 운영담당자에게 적절한 교육을 이수한 사람이 속한 기관에 한해서 신청 가능.

*예약일 기준 1일전 취소 가능, 당일 취소 불가.

3. SHRIMP

전문연구지원과제				이용수가 (부가세 포함, 단위:원)
장비시스템 영문명 (Fullname)	장비시스템 국문명	세부 분야	단 위	
Sensitive High Resolution Ion MicroProbe System	SHRIMP System	직접 분석	1 일 기준	880,000
		위탁 분석	1 일 기준	1,540,000

4. 900MHz NMR

전문연구지원과제				이용수가 (부가세 포함, 단위:원)
장비시스템 영문명 (Fullname)	장비시스템 국문명	세부 분야	단 위	
900 MHz Cryo NMR Spectrometer	900 MHz Cryo 핵자기공명 분광기	실온영역	1 일 기준	264,000

5. 차세대 융복합 in situ 나노분석 시스템

전문연구지원과제				이용수가 (부가세 포함, 단위:원)
장비시스템 영문명 (Fullname)	장비시스템 국문명	세부 분야	단 위	
The development of multi-disciplinary in situ analytical system for nanotechnology and related science	차세대 융복합 in-situ 나노분석 시스템	표면 및 계면 연구	1 일 기준	550,000

6. Nano-SIMS

전문연구지원과제				이용수가 (부가세 포함, 단위:원)
장비시스템 영문명 (Fullname)	장비시스템 국문명	세부 분야	단 위	
Nano Secondary Ion Mass Spectrometer	초미세 이차이온 질량분석기	Mass Spectrum	1 일 기준	495,000
		Depth Profile	1 일 기준	
		Isotope Analysis	1 일 기준	
		Image Acquisition	1 일 기준	

7. 펨토초 레이저 시스템

전문연구지원과제				이용수가 (부가세 포함, 단위:원)
장비시스템 영문명 (Fullname)	장비시스템 국문명	세부 분야	단 위	
Femtosecond Multi-dimensional Laser Spectroscopic System	펨토초 다차원 레이저 분광 시스템	이차원(시분해) 분광 측정 시스템	1 일 기준	550,000
		파장가변 고출력 레이저 광원	1 일 기준	132,000
		UV-Vis-IR 흡광 광도계	1 일 기준	55,000